

Judul:

Deposisi lapisan tipis nitrida : silikat dengan metode implantasi ion dan analisis sifat-sifat optisnya

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Binding Energy ; Energy Beam Deposition ; X-ray Spectra

Nomor Panggil:

JURFIN 3:11 (1999)

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)